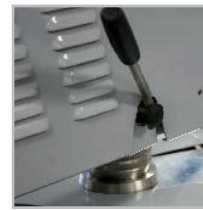
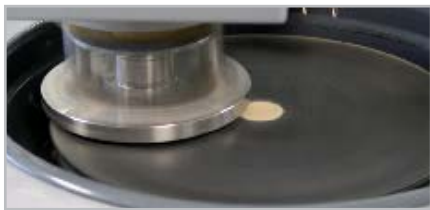


Saphir 530是一款用于 \varnothing 200 - 250 mm工作盘径的双盘研磨抛光机，并配有顶部装载的研磨抛光头Rubin 500. 本机以其易于操作和宽应用范围的特性可以为用户提供最大的便利。它还具有顺序操作时间、向下压力、转速控制、旋转方向、气动式升降、单点压力和中心压力、程序存储以及其它特性。另外，它还具有Saphir 320的所有优点，是一款富有特色的机器。



可变转速

工作盘的转速可通过研磨抛光头Rubin 500的控制面板进行设置。在工作中，转速也可以改变。

电子控制

控制面板的设计非常稳定。所有参数都可以通过控制旋钮进行更改。逻辑设计业使得操作更容易。

水

供水通过手动开关控制。冲洗龙头可以拉出，通过软管扩展清洁内罩。通过在左右旋转龙头可以在工作盘上水流的最佳分配。





基本模块

**SAPHIR 530 RUBIN 500**

订货号: M5630040

- » 带有Rubin 500的双盘研磨抛光机
- » 单点压力和中心压力
- » 可变转速
- » 配有LCD显示的电子控制
- » 可编程存储器
- » 抛光头: 顺时针/逆时针旋转
- » 气动调节高度
- » 手动旋转磨抛头到任何位置
- » 自动水电磁阀控制
- » 废料收集盘
- » 包括防溅环和上盖
- » 铝制机架, 粉末涂层
- » 耐冲击塑料内罩

设备

电源 (可选)

选项 1

230 V/50 Hz (1/N/PE)

订货号.: A5630007

选项 2

110 V/60 Hz (1/N/PE)

订货号.: A5630008



E-Lab ready

Working wheels, sample holders etc. see page 3.41 and further.
Technical changes are reserved.

配件

磨抛液滴定器 130



订货号: M6300040

- » 自动滴定器, 3x悬浮液, 1x润滑液
- » 滴定量可调节
- » 倒吸功能
- » 手动或自动功能
- » 宽x高x深
- » 重量

大约 220 x 150 x 200 mm

2 kg

电源 (可选)

选项 1

230 V/50 Hz (1/N/PE)

订货号: A6300001

选项 2

110 V/60 Hz (1/N/PE)

订货号: A6300002

滴定器喷嘴保持架 TOPAS 130



订货号: A6300003

- » 适用于自动模式

废料沉淀槽

- » 双格室, 粉末涂层, 45 L
- » 溢流装置和滤网



适用于系统实验室
(可插入系统实验室橱柜)
订货号: A5800029



移动式
订货号: A5800051

系统实验室橱柜



订货号: M5800042

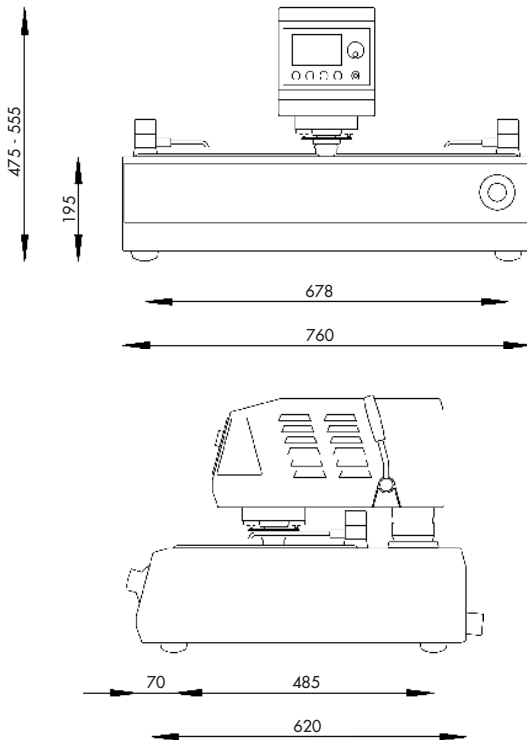
- » 系统实验室装配
- » 宽x高x深

880x800x800 mm

连接套件

订货号: Z5600009

- » 1根排水管 \varnothing 40 mm;长1.5 m
- » 1根压力管 R 1/2";长2 m
- » 1根压力管 长3 m带接口和螺纹 R 3/8"



连接负载	1.8 kVA	
电源	1	230 V/50 Hz (1/N/PE)
	2	110 V/60 Hz (1/N/PE)
SAPHIR 530		
磨抛盘直径	Ø 200 - 250 mm	
变速	50 - 600 rpm	
RUBIN 500		
单点加压	1 - 5 试样; Ø 40 mm	
中心加压	依照夹具	
转速	140 rpm	
压力	可调	
单点加压范围	5 - 100 N	
中心加压范围	20 - 350 N	
宽x高x深	大约 760 x 475 - 555 x 620 mm	
重量	67 kg	